

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】令和 5 年 4 月 18 日(2023.4.18)

【公開番号】特開 2022-50210(P2022-50210A)
 【公開日】令和 4 年 3 月 30 日(2022.3.30)
 【年通号数】公開公報(特許)2022-056
 【出願番号】特願 2020-156679(P2020-156679)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/68(2006.01)

10

H 0 1 L 21/677(2006.01)

B 2 5 J 9/10(2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 F

H 0 1 L 21/68 A

B 2 5 J 9/10 A

【手続補正書】

【提出日】令和 5 年 4 月 10 日(2023.4.10)

【手続補正 1】

20

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0071

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0071】

ここで、計測位置 P1 は、基板 W がセンサ 61 を遮ることで基板 W の外縁を検出する位置である（センサ 61 の遮光位置）。この位置において、経路 101 と経路 201 とは一致している。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

30

【補正対象項目名】0074

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0074】

ここで、センサ 6 は、搬送機構 5 の動作（経路）に依存しない位置で基板 W の外縁を検出する。即ち、図 9 に示す例において、センサ 6 は、センサ 61 の遮光位置とセンサ 62 の投光位置に基づいて、基板 W の中心位置を算出する。これにより、計測位置 P1 から目標位置 P2 までの搬送機構 5 の伸縮動作にいたる直前の動作（経路 101, 201）が異なっていることにより、計測位置 P1 から目標位置 P2 までの動作（経路 102, 202）が異なっていたとしても動作依存のない位置で基板 W の外縁を検出することができる。これにより、同一のキャリブレーションデータを用いても、センサ 6 を用いて基板 W の中心位置と基準位置とのずれ量を算出する際の精度を向上させることができる。また、基板 W を目標位置まで搬送する際の搬送精度を向上させることができる。

40